

<i>Фаренік В.І.</i> Малоенергоємні плазмові технологічні системи з розрядами у комбінованих електричному та магнітному полях	166
<i>Дудин С.В.</i> Исследования и разработка технологических систем на базе ВЧ индукционного разряда для реактивного ионно-плазменного травления микро- и наноструктур	171
<i>Зиков О.В., Яковін С.Д., Дудін С.В.</i> Синтез діелектричних сполук на базі магнетрону постійного струму	195
<i>Лисовский В.А., Харченко Н.Д.</i> Радиальная структура продольного комбинированного разряда в SF ₆	204
<i>Стервиедов А.Н.</i> Распределение химического состава по глубине в пленках Cr-O-N, полученных методом ионно-стимулированного осаждения	210
<i>Белоус В.А., Васильев В.В., Лучанинов А.А., Решетняк Е.Н., Стрельницкий В.Е., Толмачева Г.Н., Голтвяница В.С., Голтвяница С.К.</i> Твердые покрытия Ti-Al-N, осажденные из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы	216
<i>Хороших В.М., Белоус В.А.</i> Пленки диоксида титана для фотокатализа и медицины	223
<i>Погребняк А.Д., Береснев В.М., Levintant N., Маликов Л.В., Братушка С.Н., Ердыбаева Н.К.</i> Структурно-фазовые изменения в приповерхностных слоях титанового сплава TiNi, после ионной имплантации	239
<i>Долгов А.С., Стеценко Н.В.</i> Релаксационные перестройки моноатомных слоев на поверхности.....	244
<i>Ёдгорова Д.М., Каримов А.В., Камонов Б.М., Якубов Э.Н.</i> Трехбарьерные фотодиоды на основе соединений арсенида галлия для оптических систем связи	252
<i>Ткач О.П., Однодворець Л.В., Неріжко S., Проценко С.І.</i> Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pd	256
<i>Тюрин Ю.Н., Кульков С.Н., Колисниченко О.В., Дуда И.М.</i> Импульсно-плазменное модифицирование поверхности изделия из сплава WC + 20%Co	262
<i>Хороших В.М., Леонов С.А.</i> О характере влияния различных газов на процесс конденсации покрытий из плазмы вакуумной дуги	268
<i>Азаренков Н.А., Орлов В.Д., Слипченко Н.И., Удовіцький В.Г., Фаренік В.І.</i> Обучение и подготовка кадров в области нанотехнологий и использование при этом научного наследия	273
<i>Правила оформлення рукописей</i>	281
<i>Правила оформлення рукописів</i>	282
<i>Information for authors</i>	283